



WWW.EDWARDSVACUUM.COM

エドワーズ株式会社  
マーケティング部

## 新製品発表！

### iXH500Hドライポンプシリーズを販売開始

ガス流量の多い液晶・太陽電池、半導体プロセスに最適な新型ポンプ  
さまざまなポンプ温度に柔軟に対応可能

英国ウェストサセックス州クローリー(2011年10月12日)ー真空コンポーネント、除害装置およびサービスのグローバルサプライヤーである Edwards Limited は、過酷な使用条件に対応するドライポンプとして定評のある iXH 製品群を拡張して、iXH500H シリーズを新たに発表しました。この新しいシリーズ(排気速度:500~5,200 m<sup>3</sup>/h)は、高いガス流量と柔軟なポンプ温度分析が要求される、液晶・太陽電池および高度な半導体プロセス向けに最適化されたものです。これらのポンプは、現在の iXH450 シリーズの持つ卓越した機能(軽い水素ガスの排気性能や非常に小さい設置面積(フットプリント))を受け継ぎながら、更にエネルギー消費量を低く抑え、平均サービス間隔(MTBS)を向上させているため、所有コスト(CoO)が大幅に低下できます。

エドワーズ液晶・太陽電池部門のドライポンプ・プロダクトマネージャー、Dr. Allister Watson は次の様に述べています。「今回 iXH 製品群に加わった新しいシリーズ iXH500H ポンプは、液晶・太陽電池そして高度な半導体プロセスでポンプに課されるさまざまな状況に対応するものであり、ポンプの MTBS は大幅に改善されます。これまでは、こうした過酷な条件に柔軟に対応できるドライポンプ製品はありませんでした。ポンプの温度変化に対する柔軟性が向上した iXH500H シリーズは、このニーズに応えるものです。加えて、ポンプのエネルギー消費量も最大 15%削減されます。それによって iXH500H では、従来の世代の iXH ドライポンプに比べて、30%の所有コスト(C.o.O : Cost of Ownership)削減が可能になっています」

液晶・太陽電池および半導体プロセスで使用する真空ポンプには、広範な運転状況や材料に対応する能力が求められます。温度変化に柔軟に対応できる iXH500H シリーズは、このような過酷な条件下に最適なポンプです。低い温度での稼働が可能な iXH500H シリーズは、多量の腐食性ガスを使用するプロセス(FPD PECVD、薄膜ソーラーPECVD、半導体 MOCVD など)や、副産物がポンプ内に堆積する、熱に敏感な前駆体(プリカーサー)を使用するプロセス

(原子層蒸着など)に最適です。ポンプ内で副産物が堆積するリスクのある場合(高誘電体: High-k プロセスなど)には、高温での運転も可能です。

エドワーズの iXH500H シリーズポンプは現在販売中です。既存の iXH450 シリーズポンプから新しい iXH500H シリーズへの転換を行うサービスアップグレードもご利用いただけます。

詳細については、弊社営業担当者にお問合せ下さい。



写真: iXH ドライポンプシリーズ

P  
R  
E  
S  
S  
  
R  
E  
L  
E  
A  
S  
E